

ТЕРМОЭДС В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СУБМИКРОННЫХ ПЛЕНКАХ

Логвинов Г. Н.

В полупроводниковом образце субмикронных размеров, включенном в замкнутую электрическую цепь, в приближении электронной температуры рассчитана термоэдс. Проанализированы механизмы ее возникновения, сводящиеся к созданию энергетической неоднородности, вызванной энергетическим баллистическим пролетом электронов в объеме и поверхностными термоэдс в контактах. Рассмотрены режимы холостого хода и короткого замыкания.

Создание электронных приборов на основе многослойных структур с полупроводниковыми субмикронными слоями ставит вопрос об изучении тепловых потоков как между слоями, так и внутри каждого из них. Как известно [1], под субмикронным слоем подразумевается пленка, толщина которой $2d < \tau$ (τ — объемная длина остывания электронов [2]). Если поверхность тонкой пленки контактирует с термостатами и температурами T_1^0 и T_2^0 ($T_1^0 > T_2^0$), то вдоль ее толщины (направление оси Ox) создается резкая неоднородность носителей тока по энергии, приводящая к возникновению термоэдс. Разность температур может быть создана либо целенаправленно, либо возникнуть в результате неоднородного разогрева контактов пленки с соединительными проводами протекающим электрическим током. В последнем случае появление термоэдс является побочным эффектом и электрическое поле в образце должно находиться самосогласованным образом. Заметим, что рассматриваемая далее задача идеологически близка к теоретическому описанию (см. [3]) появившихся в последнее время экспериментов по термоэлектрическим явлениям в микроконтактах [4, 5].

В отличие от массивных образцов ($\tau < 2d$) механизм термоэдс в субмикронных слоях обуславливается, во-первых, поверхностными энергетическими релаксационными процессами, во-вторых, условиями протекания потоков заряда и тепла в контактах образца и внешней цепи. Это обстоятельство позволяет в принципе получить информацию о физических процессах, происходящих на поверхности и в контактах, путем экспериментального определения термоэдс и плотности тока в замкнутой цепи.

Цель настоящей работы — построение теории термоэдс в субмикронных пленках, называемых в дальнейшем субмикронными термоэлементами (СТЭ), при условии замкнутости электрического контура вдоль энергетической неоднородности и допущении максвелловости симметричной части функции распределения электронов.

В отличие от массивного образца, в котором условием максвелловского распределения носителей служит неравенство $l_{ee} < l$, где l_{ee} — длина межэлектронного взаимодействия [6], в субмикронных слоях соответствующее условие принимает вид $l_{ee} < l, \bar{d}$, где \bar{d} — поверхностная длина остывания, определяемая взаимодействием электронов с поверхностными рассеивателями [7]. Поскольку в субмикронных слоях, как правило, $\bar{d} < l$, т. е. релаксация энергии происходит через границы, условие максвелловости функции распределения становится более жестким — $l_{ee} < \bar{d}$. При

неизменных геометрических размерах образца данное неравенство будет иметь место при не очень больших скоростях поверхностной релаксации энергии, однако надо помнить, что в субмикронном слое они превышают скорости потерь энергии в объеме. (Последнее подробно обсуждено в [1], [7]). Аналогичная картина имеет место и для акустических фононов.

Электрическая цепь состоит из СТЭ размером $-d < x < d$ и металлического проводника длиной $2L \gg 2d$. Равновесную проводимость СТЭ и проводника обозначим через σ и σ_0 . Электроны в образце предполагаются невырожденными, находящимися при температуре $T_e(x)$, температуры электронного и фононного газов внешней цепи считаются постоянными, равными средней температуре $T^* = \frac{1}{2}(T_1^0 + T_2^0)$.

В целях упрощения мы на всех участках цепи полагаем величину радиуса Дебая наименьшей длиной. Импульсная длина пробега l предполагается значительно меньшей всех геометрических размеров рассматриваемой модели, включая контакты. Процессы электрон-фононного увлечения пренебрегаем.

Отличительной особенностью СТЭ является то, что в его объеме электроны не обмениваются энергией с кристаллической решеткой ($l > 2d$). Из этого следует, что в образце имеется два не взаимодействующих между собой газа квазичастиц-электронов и фононов, по которым протекают порознь два независимых потока тепла — электронный Q_e и фононный Q_p .

Для расчета термоздс необходимо знать пространственное распределение температуры $T_e(x)$ в СТЭ. При заданных температурах внешних термостатов она, очевидно, будет определяться релаксационными процессами электронов и фононов на поверхностях образца. Заметим, что на самой границе и внутри контакта пренебрегать электрон-фононным взаимодействием мы не имеем права. Релаксационные процессы в данном случае определяются не длиной l , а поверхностной длиной остывания \bar{l} [7], которая может быть значительно меньше l (об этом свидетельствуют экспериментальные факты [8, 9]). Поэтому электроны могут отдавать свою энергию в термостаты путем непосредственной поверхностной электронной теплопроводности либо благодаря поверхностному электрон-фононному взаимодействию с последующим выводом тепла через фононную систему, либо же конвекционным способом при наличии электрического тока j . Фононы же релаксируют по энергии могут в процессе поверхностной теплопроводности или в процессе фонон-электронных столкновений с выводом ее в термостат через электронную систему. В общем случае в процессе установления стационарных температурных полей следует учитывать все перечисленные релаксационные механизмы.

Замкнутая система уравнений для решения поставленной задачи состоит из уравнений теплового баланса для электронов и фононов и уравнений Максвелла для квазинейтральной среды [10]. В применении к СТЭ они имеют следующий вид:

$$\frac{dQ_e}{dx} = jE, \quad \frac{dQ_p}{dx} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{dj}{dx} = 0, \quad E = -\frac{d\varphi}{dx}. \quad (2)$$

Здесь

$$Q_e = \kappa_e \frac{dT_e}{dx} + \left[\Pi(T_e) + \frac{1}{e} \mu(T_e) \right] j, \quad (3)$$

$$Q_p = -\kappa_p \frac{dT_p}{dx}, \quad (4)$$

$$j = -\sigma \left(\frac{d\tilde{\varphi}}{dx} + \alpha \frac{dT_e}{dx} \right), \quad (5)$$

где Π , μ — объемные коэффициент Пельтье и химический потенциал электронов в СТЭ; $\kappa_{e,p}$ — объемные электронный и фононный коэффициенты теплопроводности; φ , $\tilde{\varphi} = \varphi + \frac{1}{e}\mu$ — электрический и электрохимический потенциалы в полупроводнике; α — коэффициент дифференциальной термоэдс.

Граничными условиями (ГУ) для уравнений (1), (2) служат следующие равенства [10]:

$$Q_c + j\varphi \Big|_{\xi=\pm 1} = \pm \left(\Pi_s + \frac{\mu + \mu_0}{2e} \right) j \pm \kappa_{es} (T_e - T_{2,1}^0) \pm \eta_e (T_e - T_p) \Big|_{\xi=\pm 1}, \quad (6)$$

$$Q_p \Big|_{\xi=\pm 1} = \pm \kappa_{ps} (T_p - T_{2,1}^0) \pm \eta_p (T_p - T_e) \Big|_{\xi=\pm 1}, \quad (7)$$

$$j \Big|_{\xi=\pm 1} = \sigma [\tilde{\varphi} - \tilde{\varphi}_0 + \alpha_s (T_e - T_{2,1}^0)] \Big|_{\xi=\pm 1}, \quad (8)$$

где $\xi = x/d$; Π_s , $\kappa_{e,p,s}$, α_s , σ_s — поверхностные коэффициенты Пельтье, теплопроводности, термоэдс и электропроводности; $\tilde{\varphi}_0$ — электрохимический потенциал металла; $\eta_{e,p}$ — параметры, характеризующие скорости поверхностной релаксации энергии электронов и фононов.

Для дальнейшего важно отметить, что, как следует из (8), при отличной от нуля плотности электрического тока на границе двух сред электрохимический потенциал непрерывный лишь при $\sigma_s \rightarrow \infty$.¹ В общем случае он претерпевает разрыв, и этот факт необходимо учитывать при расчетах термоэлектрических эффектов в ограниченных полупроводниках.

В целях упрощения расчетов мы предполагаем, что разность приложенных извне температур мала, так что имеет место следующее неравенство:

$$t = \frac{\Delta T^0}{T^*} \ll 1, \quad (9)$$

где

$$\Delta T^0 = T_1^0 - T_2^0. \quad (10)$$

Так как единственной причиной неоднородности по энергии является пространственная неоднородность температуры в СТЭ, обусловленная разностью ΔT^0 , все потоки электрического заряда и тепла являются линейными откликами на величину t . Это позволяет в данном приближении в уравнениях баланса и ГУ пренебречь джоулевым разогревом.

Решая уравнения (1) совместно с (6), (7), можно легко получить следующие выражения для температур:

¹ В температурном приближении при сделанных ранее предположениях в контакте справедлив закон Видемана—Франца, из которого следует, что при $\sigma_s \rightarrow \infty$ и $\kappa_{e,s} \rightarrow \infty$, а значит, $T_e \Big|_{\xi=\pm 1} \rightarrow T_{2,1}^0$.

$$T_p(\xi) = -\frac{\beta_p^0}{\beta_p^0 + \beta_p + 1} \left(\frac{T_1^0 - T_2^0}{2} + \frac{\beta_p}{\beta_p^0} \frac{T_{e1} - T_{e2}}{2} \right) + \frac{\beta_p^0}{\beta_p^0 + \beta_p} \left(T^* + \frac{\beta_p}{\beta_p^0} \frac{T_{e1} + T_{e2}}{2} \right), \quad (11)$$

$$T_e(\xi) = \left[-\frac{\beta_e^0}{\beta_e^0 + \beta_e + 1} \left(\frac{T_1^0 - T_2^0}{2} + \frac{\beta_e}{\beta_e^0} \frac{T_{p1} - T_{p2}}{2} \right) + \frac{\Phi d}{\kappa_e j} \right] \xi + \frac{\beta_e^0}{\beta_e^0 + \beta_e} \left(T^* + \frac{\beta_e}{\beta_e^0} \frac{T_{p1} + T_{p2}}{2} \right) - \frac{d}{\kappa_e} [\Lambda + (\beta_e^0 + \beta_e) \Phi] j. \quad (12)$$

В равенствах (11), (12) $\Phi = \Pi + \frac{1}{e} \mu$; $\Lambda = \Pi_s + \frac{\mu_0 + \mu_1}{2e}$; T_{ei} , T_{pi} ($i = 1, 2$) — электронная и фононная температуры на границах СТЭ;

$$\beta_e^0 = \frac{\kappa_{e0} d}{\kappa_e} = \frac{d^2}{\bar{d}_{e0}^2}; \quad \beta_e = \frac{\eta_e d}{\kappa_e} = \frac{d^2}{\bar{d}_e^2}, \quad (13)$$

где \bar{d}_{e0} , \bar{d}_e — поверхностные длины остывания электронов, определяемые диссипацией энергии в результате поверхностной теплопроводности и квазиупругого рассеяния на поверхностных акустических фоновых [1, 7],

$$\beta_p^0 = \frac{\kappa_{ps} d}{\kappa_p} = \frac{d^2}{\bar{d}_{p0}^2}; \quad \beta_p = \frac{\eta_p d}{\kappa_p} = \frac{d^2}{\bar{d}_p^2}. \quad (14)$$

Здесь \bar{d}_{p0} , \bar{d}_p — введенные аналогично электронам поверхностные длины остывания фононов. В настоящей работе все поверхностные длины играют роль феноменологических параметров теории.

Из выражений (11), (12) следует, что температурные распределения электронов и фононов в субмикронном образце обусловлены главным образом состоянием поверхностных тепловых контактов (соотношениями между поверхностными длинами остывания). Если, например, поверхностное фонон-электронное взаимодействие слабое ($\bar{d}_p \gg \bar{d}_{p0}$), то температура $T_p(\xi)$ имеет следующий вид:

$$T_p(\xi) = T^* - \frac{\beta_p^0}{\beta_p^0 + 1} \frac{T_1^0 - T_2^0}{2} \xi. \quad (15)$$

Температура фононов «подстраивается» к температуре термостатов.

В случае же, когда поверхностная теплопроводность является основным каналом релаксации энергии фононов ($\bar{d}_p \ll \bar{d}_{p0}$), выражение для температуры $T_p(\xi)$ видоизменяется:

$$T_p(\xi) = \frac{T_{e1} + T_{e2}}{2} - \frac{\beta_p}{\beta_p + 1} \frac{T_{e1} - T_{e2}}{2} \xi, \quad (16)$$

т. е. определяется граничными электронными температурами, отличными, вообще говоря, от температур термостатов. Аналогичная картина имеет место и для электронного газа.

Исключая в (11), (12) граничные фононные температуры, получаем окончательное выражение для температуры $T_e(\xi)$:

$$T_e(\xi) = T^* - \frac{d}{\alpha_e} (\Phi + B\Lambda) j + \frac{d}{\alpha_e} \left(j_0 \Phi - A \frac{\alpha_e}{d} \right) \frac{T_1^0 - T_2^0}{2} \xi, \quad (17)$$

где

$$A = \frac{\beta_p^0 \beta_e^0 + \beta_e^0 (\beta_p^0 + \beta_p + 1)}{(\beta_e^0 + 1) \beta_p + (\beta_p^0 + 1) \beta_e + (\beta_e^0 + 1) (\beta_p^0 + 1)}; \quad (18)$$

$$B = \frac{\beta_p^0 + \beta_p}{\beta_p^0 \beta_p^0 + \beta_e^0 \beta_p + \beta_p^0 \beta_e}; \quad j_0 = \frac{j}{\Delta T^0}. \quad (19)$$

Из выражения (17) следует, что градиент T_e отличен от нуля при наличии электрического тока и условии $A \neq 0$. Из равенства (18) следует, что $A = 0$ при $\beta_e = \beta_e^0 = 0$ или же $\beta_p^0 = \beta_p = 0$. Это означает, что на границах СТЭ отсутствует теплообмен с фоновым газом и термостатами либо же при имеющемся электрон-фононном взаимодействии ($\beta_e \neq 0$) тепловые контакты электронного и фоновых газов с термостатами адиабатические.

Во втором предельном случае изотермических граничных условий ($\bar{\alpha}_{p0} \rightarrow 0, \bar{\alpha}_{e0} \rightarrow 0$) коэффициент $A = 1$.²

Для вычисления плотности тока j воспользуемся законом Кирхгофа для замкнутой электрической цепи:

$$\oint \frac{jd\mathbf{l}}{\sigma} = \oint \mathbf{E}^* d\mathbf{l} = jR, \quad (20)$$

где \mathbf{E}^* — напряженность термоэлектрического поля, R — полное сопротивление замкнутого контура. Полагая его во всех точках однородным, а сечение единичным, можно записать

$$R = \frac{2d}{\sigma} + \frac{2L}{\sigma_0} + \frac{2}{\sigma_s}. \quad (21)$$

Интегрирование по замкнутому контуру должно включать в себя ГУ (8) [11] и схематически выглядит следующим образом:

$$\oint \dots = \int_{-\infty}^{\infty} \dots = \int_{-\infty}^{-1} \dots + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{-1-\delta}^{-1+\delta} \dots + \int_{-1}^1 \dots + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{1-\delta}^{1+\delta} \dots + \int_1^{\infty} \dots \quad (22)$$

После подстановки выражения (5) в интеграл (20) и учета ГУ (8) получаем следующее выражение:

$$\oint \frac{jd\mathbf{l}}{\sigma} = \alpha_s (1 - A) \Delta T^0 - 2 \left(\frac{1}{e} \frac{d\mu}{d\Theta} + \alpha T^* \right) \frac{d\Theta}{d\xi}, \quad (23)$$

где $\Theta = \frac{T_e}{T^*}$.

При интегрировании выпали первый и последний интегралы в (22), так как они относятся к интегрированию по металлическим участкам цепи, в которых температура постоянная.

Объединяя формулы (20), (21), (23) и (17), получаем выражение для плотности тока j

² Данный случай в рамках предлагаемой теории естественно может иметь место только при условии $l_{ee} \ll \bar{\alpha}_e, \bar{\alpha}_{e0}$.

$$j = \sigma \frac{\alpha_s(1-A) + 2A \left(\frac{1}{e} \frac{d\mu}{d\Theta} + \alpha T^* \right)}{1 + \frac{\sigma L}{\sigma_0 d} + \frac{\sigma}{\sigma_s d} + \frac{\sigma}{\kappa_s T} + \left(\frac{1}{e} \frac{d\mu}{d\Theta} + \alpha T^* \right) \Phi} \frac{t}{2d}. \quad (24)$$

В невырожденных полупроводниках $\frac{1}{e} \frac{d\mu}{d\Theta} + \alpha T^* = \frac{1}{e} (1-q) T^*$,

$$\frac{\sigma}{\kappa_s} = \frac{e^2}{\left(\frac{5}{2} - q \right) T^*}; \quad (25)$$

$$\frac{e\Phi}{T^*} = \frac{e}{T^*} \left(\Pi + \frac{1}{e} M \right) = \frac{e}{T^*} \left(\alpha T^* + \frac{1}{e} \mu \right) = \frac{5}{2} - q.$$

Здесь q — параметр рассеяния импульса в объеме СТЭ.

После подстановки (25) в (24) получаем

$$j = \sigma \frac{\alpha_s(1-A) + \frac{2}{e} A(1-q) \frac{\Delta T^0}{2\alpha}}{2 + \frac{\sigma L}{\sigma_0 d} + \frac{\sigma}{\sigma_s d} - q}. \quad (26)$$

Согласно общему определению ЭДС, термоэдс в замкнутом контуре представляется в виде [12]

$$\varepsilon = \oint E^* dl = jR. \quad (27)$$

Отсюда и из формул (21), (26) получаем окончательное выражение для измеряемой термоэдс в СТЭ

$$\varepsilon = \tilde{\alpha} \Delta T^0, \quad (28)$$

где коэффициент термоэдс имеет следующий вид:

$$\tilde{\alpha} = \frac{[\alpha_s(1-A) + \frac{2k}{e} A(1-q)] \left(1 + \frac{\sigma L}{\sigma_0 d} + \frac{\sigma}{\sigma_s d} \right)}{2 + \frac{\sigma L}{\sigma_0 d} + \frac{\sigma}{\sigma_s d} - q}, \quad (29)$$

где k — постоянная Больцмана.

Проанализируем выражение (29). Ясно, что в СТЭ механизм термоэдс иной, чем в массивном полупроводнике. В общем случае он определяется, во-первых, баллистическим переносом энергии в объеме образца, получаемой электронами у термостата с температурой T_1^0 , и последующей ее отдачей термостату с температурой T_2^0 (при $A \neq 0$), во-вторых, термоэдс возникает непосредственно в самом контакте полупроводника и металла (при $\alpha_s \neq 0$). При адиабатических тепловых кон-

тактах ($A = 0$) термоэдс генерируется только на границах, при изотермических — в объеме СТЭ. Это понятно, так как в первом случае в субмикронном образце в электронной системе отсутствует поток тепла, во втором — температуры электродов на «внутренней» и «внешней» сторонах контакта одинаковы.

Из (29) видно, что величина $\tilde{\alpha}$ существенно зависит от соотношений между проводимостью σ и проводимостями σ_0 , σ_s . Рассмотрим два предельных случая: холостого хода $\left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \gg 1, \frac{\sigma}{\sigma_s} \gg 1\right)$ и короткого замыкания $\left(\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{\sigma}{\sigma_s} = 0\right)$.

В первом из них

$$\tilde{\alpha} = \alpha_s (1 - A) + \frac{2k}{e} (1 - q). \quad (30)$$

При изотермических контактах $\tilde{\alpha} = \frac{2k}{e} (1 - q)$ и определяется исключительно механизмом рассеяния импульса. Максимальная термоэдс имеет место при рассеянии на ионизированных примесях ($q = -3/2$). Величина $\tilde{\alpha}$ при этом составляет 532 мкВ/град. При адиабатической изоляции $\tilde{\alpha} = \alpha_s$. К сожалению, экспериментальные данные о поверхностных характеристиках, используемых в данной работе, отсутствуют, поэтому привести численный сравнительный анализ не представляется возможным.³

В случае короткого замыкания бесконечность величины σ_s автоматически приводит к изотермическим ГУ [см. ссылку¹ и формулу (18)]. Коэффициент $\tilde{\alpha}$ при этом определяется следующим выражением:

$$\tilde{\alpha} = \frac{2k}{e} \frac{1 - q}{2 - q}. \quad (31)$$

И в этом предельном случае величина термоэдс задается лишь механизмом рассеяния импульса. Она максимальна при $q = -3/2$ и равна 104 мкВ/град.

В заключение выражаю благодарность Ю. Г. Гуревичу за постоянное внимание к работе и обсуждение полученных результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 10. С. 1715—1720.
- [2] Грибников З. С., Мельников В. И., Сорокина Т. С. // ФТТ. 1966. Т. 8. В. 11. С. 3379—3382.
- [3] Богачек Э. Н., Шкорбатов А. Г. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 12. С. 2234—2237.
- [4] Gerlach-Meyer U., Queisser H. J. // Phys. Rev. Lett. 1983. V. 51. N 20. P. 1904—1906.
- [5] Trzcinski R., Gmelin E., Queisser H. J. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 10. P. 1086—1089; Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 12. P. 6373—6378.
- [6] Рашба Э. И., Грибников З. С., Кравченко В. Я. // УФН. 1976. Т. 119. В. 1. С. 3—46.
- [7] Логвинов Г. Н. // Изв. вузов СССР. Физика. 1991. № 1. С. 59—64.
- [8] Климовская А. И., Кириллова С. И., Снитко О. В. // ФТП. 1974. Т. 8. В. 4. С. 702—710.
- [9] Зотьев Б. П., Кравченко А. Ф., Скок Э. М. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 7. С. 1377—1379.
- [10] Басс Ф. Г., Бочков В. С., Гуревич Ю. Г. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках. М., 1984. 288 с.
- [11] Ваксер А. И., Гуревич Ю. Г. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 1. С. 82—86.
- [12] Аныгычук Л. И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. Киев, 1979. 766 с.

Тернопольский государственный педагогический институт
им. Я. О. Галана

Получена 19.06.1991
Принята к печати 22.10.1991

³ Исключение составляет η_s , экспериментально определенное в [8, 9].